



VE-2012

真空蒸着装置

小型デスクトップ高真空蒸着装置

- デスクトップ型の本格真空蒸着装置。
- TMP+RP の排気系により清浄高真空中で蒸着可能。
- 排気操作はスイッチの ON/OFF のみの全自動。
- 蒸着源は(低輻射熱)金属蒸着金具か(替え芯専用)カーボン蒸着銃より選択。



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

特徴・仕様

特徴

- ★ VE-2012 は VE-2030(弊社製)のコンセプトを継承した簡易型真空蒸着装置です。
- ★ TMP を筐体内に内蔵したコンパクトな筐体を実現。デスクトップ型なので設置場所を取りません。RP は床置き。
- ★ 小型 TMP+RP の排気系により清浄高真空の蒸着装置を低価格で提供。
- ★ 複雑な排気操作を廃し、スイッチの ON/OFF のみのシンプルな操作系。
- ★ タングステンバスケットの使用で金・アルミニウム・クロム・銀などの蒸着が出来ます。
- ★ カーボン蒸着はシャープペンシル替え芯をカーボンとして蒸着するクランプ蒸着銃タイプを使用。(φ5mm カーボンロッドは使用出来ません。)

仕様

1. ヒーター電極 : 1 対(2 対タイプはオプション。)
2. 蒸着対象金属 : 金・アルミ・クロム・銀・カーボン その他
3. 試料ステージ : 直径 72mm
4. 蒸着源ー試料間隔 : 0mm~140mm
5. チャンバーサイズ : 内径 160mmx深さ 240mm
6. 電極間電圧/電流 : AC15V、0~30A 電流計読み取り
7. 排気系:TMP80 ℓ/min +RP 20ℓ/min
8. 真空度測定 : デジタル表示フルレンジ真空計
9. 到達真空度: 5×10^{-4} Pa 以下
10. 安全対策 : 系統別フューズ、防爆カバーはオプション。
11. 装置サイズ : W398 × D380 × H550 (mm) 25Kg
12. 電源 : 単層 AC 100 V, 15A アース線付3芯プラグ使用

オプション

- ★ ヒーター電極 2 対化(蒸着源の 2 極対応は別途必要となります。)
- ★ 樹脂製 防爆用カバー
- ★ 基盤蒸着用試料台(一式)……下面から上方に蒸着する治具です。
- ★ 選択した蒸着源以外の蒸着源を別途購入していただけます。

*** 詳細に関するお問い合わせは代理店または営業担当までお問い合わせ下さい。**

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

VE2012-091118